

# NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2012年03月05日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。  
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号: <input type="text" value="2010000082"/> 整理番号 <input type="text" value="11434"/> 担当者 <input type="text" value="松岡 義人"/>
表 題	<input type="text" value="磁気回路による回転磁場プラズマ生成法の効率化"/>
技術分野	<input type="text" value="電気・電子"/> <input type="text" value="機械・加工"/>
適用製品	<input type="text" value="CVD, イオンエンジン, 表面処理など"/>
目 的	<input type="text" value="電極を使用せずに空間中に定常に円環状電流を駆動することができる回転磁場 (Rotating Magnetic Field: RMF) 法は, 光源やスラスタなど様々な応用が提案されている。このRMF法について, プラズマの生成効率(プラズマ電流/入力電力)を向上させ, プラズマ処理などの省電力化を図ることが目的である。"/>
技術概要	<input type="text" value="RMF法は, 磁場を生成する2対のコイル(RMFアンテナ)におよそ1/4周期の位相差を与えた交番電流を加えることで, 円柱状空間内を横切る回転磁場を生成し, 無電極で円環状電流を駆動する物である。この手法により生成されたプラズマは, 極端紫外光源や電気推進, プラズマセイルの展開などの応用へ向けた開発が進められている。プラズマ処理法として利用する場合は, 電極を用いないために不純物の混入量を低減することが可能であり, また, 電気推進などにおいては, 電極損耗による機能低下の恐れがない。&lt;br/&gt;本発明は, この回転磁場法について, 適切な磁気回路を用いることで, そのプラズマ発生効率を向上させるものである。"/>

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時	<input type="text"/>		
(ふりがな) 氏 名	<input type="text"/>		
会社名	<input type="text"/>		
所 属	<input type="text"/>	役職	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
連絡事項	<input type="text"/>		



【申込み・問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター(NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@nihon-u.ac.jp